

附件 1

JEM-F200 场发射透射电子显微镜

一、基本功能

1. 可进行微观结构分析，拍摄明场像、暗场像、高分辨像、扫描透射高角环形暗场像；

2. 可进行选区电子衍射和会聚束电子衍射，分析微区晶体结构、样品厚度以及材料应变场；

3. 配备能谱仪，可进行微区成分分析；

二、技术指标

1. TEM 线分辨率：0.10 nm@200 kV，点分辨率：0.23 nm@200 kV；

2. STEM-HAADF 点分辨率：0.16 nm@200 kV；

3. 能谱仪（EDS）能量分辨率：136 eV。

三、仪器特色

1. 搭载冷场发射电子枪，最高分辨率达 0.1 nm；

2. 能够实现自动进出样品杆；

3. 配有双探头超级能谱仪（探头面积 200 mm²），能够在任意样品倾角下实现快速高精度的 EDS 分析；

4. 搭载有 RIO16 高速相机，成像质量更高。